

スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会（SP 部会）
第 168 回定例研究会
テーマ：「Nano-ISSP 2021～スパッタリングの基礎から応用まで」

本年は「第 16 回スパッタリングおよびプラズマプロセス国際シンポジウム“The 16th International Symposium on Sputtering and Plasma Processes: ISSP 2021”」の開催年となっていました。新型コロナウイルス感染拡大が懸念されることから 2022 年に開催される国際真空会議（International Vacuum Congress）との合同開催となり、今年度は海外研究機関との交流が叶わない状況となりました。そこで SP 部会では、最近のオンライン会議の利点を活用し、小規模ではありますが本部会の定例研究会として、スパッタリングの基礎から応用に関して、国内外の研究者間の交流ができる機会を設けることにしました。海外の先生方にもご協力をお願いし、できるだけ無理のない時刻の開催となるように設定しました。多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。

日 時： 2021 年 9 月 2 日（木） 15:00～18:50（接続受付 14:30～）

開催方法： オンライン(Zoom[®])

※当日の Zoom 会議にご参加をいただくには、Zoom での参加登録が必要となります。
参加登録のためのリンク情報等の詳細は、お申込みいただいた方に別途ご案内します。

講演プログラム ※講演時間 40 分（質疑応答 5 分間含む）

- 15:00～15:05 開会の挨拶 ISSP 2021 実行委員会 委員長（産総研） 田嶋一樹
- 15:05～15:45 “Deposition of various TCO’s and the functional oxide films by dc reactive sputtering; (1) with plasma-emission or impedance feedback systems, (2) hollow cathode gas flow sputtering”, Prof. Yuzo Shigesato (Aoyama Gakuin University, Japan)
- 15:45～16:25 “High-density arc plasma technology to tailor oxygen-related defects and its critical roles for achieving unconventional metal oxide films”, Prof. Tetsuya Yamamoto (Kochi University of Technology, Japan)
- 16:25～16:45 休 憩
- 16:45～17:25 “On the deposition rate during reactive sputtering?”, Prof. Diederik Depla (Ghent university, Belgium)
- 17:25～18:05 “Bipolar HiPIMS for low-energy ion-bombardment during growth of dielectric thin films”, Prof. Ulf Helmersson (Linköping University, Sweden)
- 18:05～18:45 “On electron heating, deposition rate and ion recycling in the high power impulse magnetron sputtering discharge”, Prof. Jon Tomas Gudmundsson (University of Iceland, Iceland)
- 18:45～18:50 閉会の挨拶 日本表面真空学会 SP 部会 部会長（京都大学） 後藤康仁

参加定員： 70 名程度

参加費： SP 部会会員	無 料
日本表面真空学会個人正会員	3,000 円
日本表面真空学会法人正会員、維持会員、賛助会員に属する方	3,000 円
教育機関、公的機関に属する方	3,000 円
学生（※講演資料集冊子の配布はございません）	無 料
一般	5,000 円

申込方法： ホームページ（<https://www.jvss.jp/>）の申込フォームよりお申し込みください。
※お申し込みをいただいた方全員に電子版の講演資料を配布いたしますが、講演資料集冊子のハードコピーをご希望の方には、会議に先だって郵送します。ただし、8月25日（水）15時以降にお申し込みされた場合は、冊子の到着は開催日以降になりますのでご了承ください。

申込締切： 2021 年 8 月 23 日（月） ⇒ 8 月 31 日（火）に延長しました。

支払方法： 銀行振込、クレジット決済（Paypal）

申込受付完了後、請求書をメール添付にてお送りします。
なお、「参加者の都合による取り消し及び不参加」の場合、参加費の払い戻しはいたしません。
ただし、参加者の変更は差し支えありません。

問合せ先： 公益社団法人日本表面真空学会 事務局 TEL 03-3812-0266 E-mail: office@jvss.jp

本件担当： 日本表面真空学会 SP 部会 中野武雄（成蹊大学）、板垣奈穂（九州大学）、清水徹英（東京都立大学）